

事業者名	地方独立行政法人京都市産業技術研究所								
機器名	薄膜ストレス測定装置								
写真									
特徴・用途	<p>本装置は、基板上に金属膜や酸化膜等の薄膜を成膜した際に生じるストレス(応力)や、温度変化時に薄膜にかかるストレスを測定することが可能である。また、得られた値から弾性係数や熱膨張係数を算出することができる。これらの値を測定することは、様々な部材や製品の物性制御・設計の指針となる。</p>								
設置場所	地方独立行政法人京都市産業技術研究所								
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)
					件数(件)	時間(時間)			
	平成28年2月	10	0	0	0	0	0	10	10
	平成28年3月	10	4	0	0	0	6	0	10
	平成28年4月	13	1	0	0	0	9	3	13
	平成28年5月	12	1	0	0	0	11	0	12
	平成28年6月	9	1	0	0	0	12	6	19
	平成28年7月	17	2	0	0	0	12	7	21
	平成28年8月	14	1	0	0	0	8	5	14
	平成28年9月	13	1	0	0	0	10	2	13
	平成28年10月	10	0	0	0	0	8	2	10
	平成28年11月	15	1	0	0	0	8	6	15
	平成28年12月	10	0	0	0	0	7	3	10
	平成29年1月	12	0	0	0	0	8	4	12
	平成29年2月	11	1	0	0	0	6	4	11
平成29年3月	12	2	0	0	0	10	2	14	
利用者等の声	測定が迅速に行うことができ、応力値を素早く知ることが出来るのでよし。								
補助事業概要 の広報資料	http://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h27/pdf/27-050koho.pdf								